

## 集束イオンビーム加工観察装置 (FIB)

(日立ハイテクノロジーズ : FB-2100)

きわめて細く集束したGaイオンによるイオンビームを試料表面で走査することによって発生した二次電子などを検出して顕微鏡像を観察したり、エッチングや化合物ガスを試料表面のイオンビーム照射領域近傍に吹き付けることによってデポジション(W膜を形成)をマスクレスで行うことができる装置です。マイクロサンプリングで微小な試料を持ち運ぶことが可能なので、試料の所定箇所のエッチングを行い薄片として取り出すTEM試料作製加工や断面を露出させて観察する断面加工観察を行うことができます。



### 【仕様】

試料サイズ	最大φ100×23(h)mm
試料ステージ	5軸電動ユーセントリックステージ
加速電圧	10~40 kV(10kVステップで切り替え)
最大ビーム電流	30nA以上
最大ビーム電流密度	25A/cm <sup>2</sup> 以上
SIM像分解能	6nm 以下
倍率 (ディスプレイ上)	700 ~ 90,000 倍
イオン源	Ga液体金属イオン源

設置場所 C10棟クリーンルーム (クラス 1000)

カテゴリー 加工